

### 3. วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์โดยไม่ใช้ตัวกระตุ้น

ทำความสะอาดแผ่นทองแดงขัดด้วยกระดาษทราย ล้างด้วยอะซิโตน และ De-ionized water หลาย ๆ ครั้ง จากนั้นเป่าให้แห้ง วางตัวอย่างแผ่นทองแดงลงใน alumina boat นำไปสังเคราะห์ในเตาท่อควอทซ์ (quartz tube furnace) สังเคราะห์ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ภายใต้บรรยากาศของอากาศปกติ แก๊สออกซิเจน และ ไอน้ำ ที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ตามธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้อง นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดบนแผ่นทองแดงไปศึกษาวิเคราะห์สมบัติบ่งชี้ด้วยเครื่องมือ XRD, SEM และ EDX และศึกษาผลของเวลาในกระบวนการไอระเหยที่มีต่อโครงสร้างนาโน

#### 3.2 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์โดยใช้ตัวกระตุ้น

เตรียมสารประกอบ  $\text{CuC}_2\text{O}_4$  โดยนำ  $\text{Cu (OAC)}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  5 กรัมและ  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  และ ether 10 ml มาผสมและบดรวมกัน แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่น และเอทานอล นำตัวอย่างไปอบให้แห้งจากนั้นล้างออกด้วยน้ำกลั่นและอะซิโตน กรองและนำไปอบให้แห้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผงสีฟ้าซึ่งมี  $\text{CuO}$  nanoparticle เป็นองค์ประกอบ นำสารตัวอย่างที่ได้ บดผสมกับ  $\text{NaCl}$  8 แล้วใส่ในถ้วยอะลูมินาวางไว้ตรงกลางของท่อควอทซ์ เมาที่  $950\text{ }^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้อง นำตัวอย่างที่ได้มาล้างออกด้วยน้ำกลั่น และเอทานอล โดยวางในเครื่องอุลตราโซนิค และล้างออกด้วยน้ำกลั่น ปล่อยให้แห้งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีดำ นำตัวอย่างที่เตรียมได้ไปศึกษา และวิเคราะห์สมบัติบ่งชี้ด้วยเครื่องมือ เทคนิค XRD และ SEM

#### 3.3 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของทินไดออกไซด์

การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของทินไดออกไซด์ เตรียมจากสารตั้งต้น ได้แก่ ผงดีบุกบริสุทธิ์ ผงดีบุกบริสุทธิ์ผสมกับผงถ่านกะลา และผงดีบุกผสมกับผงแกรไฟท์ เป็นตัวกระตุ้น ทำความสะอาดแผ่นซิลิกอน (silicon wafer) ด้วยเอทานอลแล้วเป่าให้แห้ง เพื่อใช้เป็นฐานรองรับ(substrate) ทำการเตรียมตัวอย่าง โดยนำผงดีบุกบริสุทธิ์ ผงดีบุกบริสุทธิ์ผสมกับผงถ่านกะลา และผงดีบุกบริสุทธิ์ผสมกับผงแกรไฟท์ ด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน ใส่ลงในถ้วยอลูมินา แล้วนำไปใส่ในท่อควอทซ์ เมาที่อุณหภูมิและบรรยากาศต่าง ๆ หลังอุณหภูมิถึงจุดที่กำหนด ปล่อยให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติในบรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน

### 3.4 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของวัสดุผสมทินไดออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์

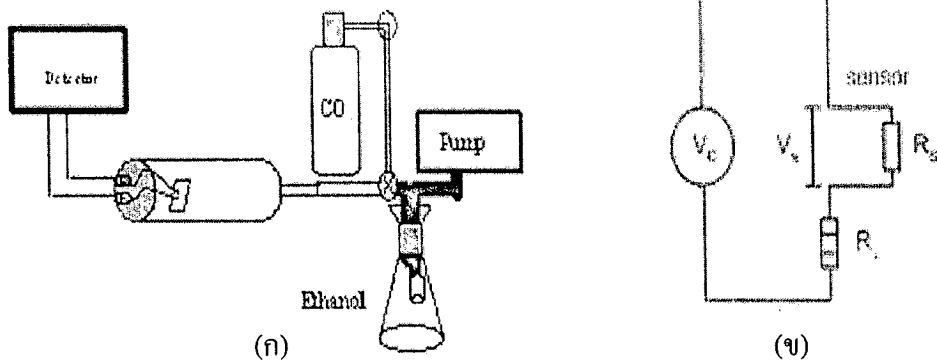
เราทำการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของวัสดุผสมทินไดออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์ โดยเตรียมจาก 2 กระบวนการ

กระบวนการที่ 1 โดยการผสมคอปเปอร์ออกไซด์โครงสร้างนาโน ซึ่งเตรียมได้จากกระบวนการการสลายตัวทางความร้อน (thermal decomposition) ของสารตั้งต้น  $\text{CuC}_2\text{O}_4$  ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีของ copper acetate 4 g ( $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ) + 5g oxalic acid ( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), + 10 ml ether นำไปอบที่  $60^\circ\text{C}$  6 ชั่วโมง แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นและอบให้แห้ง  $70\text{-}80^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วนำไปเผาพร้อมกับ NaCl 8 กรัม ที่อุณหภูมิ  $950^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมงปล่อยให้เย็นลง จะได้โครงสร้างของ CuO nanoparticles จากนั้นนำไปผสมกับผง SnO ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นใส่ลงในบีกเกอร์เติมน้ำกลั่นผสม  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ชั่วโมง โดยวัดค่า pH ประมาณ 8-9 ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นและเอทานอล อบให้แห้งที่  $105^\circ\text{C}$  4 ชั่วโมง แล้วนำไปเผาที่  $600^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 3 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศปกติ ทิ้งให้เย็นลงตามธรรมชาติจะสังเคราะห์ได้โครงสร้างนาโนของวัสดุผสมทินไดออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์ นำไปศึกษาวิเคราะห์ด้วย SEM, XRD และการตอบสนองต่อแก๊ส

กระบวนการที่ 2 โดยการผสมผงดีบุก (Sn) และผงทองแดง(Cu) ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นใส่ลงในบีกเกอร์เติมน้ำกลั่นผสม  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  โดยวัดค่า pH ประมาณ 8-9 ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ำกลั่นและเอทานอล อบให้แห้งที่  $105^\circ\text{C}$  4 ชั่วโมง แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ ภายใต้บรรยากาศปกติ ทิ้งให้เย็นลงตามธรรมชาติจะสังเคราะห์ได้โครงสร้างนาโนของวัสดุผสมทินไดออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์ นำไปศึกษาวิเคราะห์ด้วย SEM, XRD และการตอบสนองต่อแก๊ส

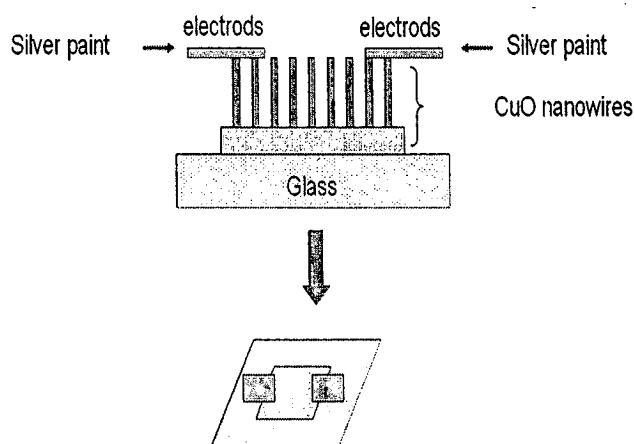
### 3.5 การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของตัวตรวจวัด(gas sensor)

การศึกษาศักยภาพการตอบสนองต่อแก๊ส ที่อุณหภูมิห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ระบบตรวจวัด การตอบสนองต่อแก๊สชนิดต่าง โดยการประกอบวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจวัด (gas sensor) แสดงดังภาพที่ 3.4 (ก) และ (ข) ตามลำดับ



ภาพที่ 3.1 ระบบการวัดการตอบสนองต่อแก๊สของตัวตรวจวัด (ก) และการประกอบวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจวัด (ข)

การวัดการตอบสนองต่อแก๊สของตัวตรวจวัดจะดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ ตัวตรวจวัดที่ประกอบด้วยโครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์ ตัวตรวจวัดที่ประกอบด้วยโครงสร้างนาโนของทินไดออกไซด์ และตัวตรวจวัดที่ประกอบด้วยชั้นโครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์ สำหรับตัวตรวจวัดคอปเปอร์ออกไซด์โครงสร้างนาโนจะถูกเคลือบลงบนกระจกสไลด์ แล้วทำด้วยกาวเงินเพื่อทำขั้วไฟฟ้าทั้งสองข้าง ตัวตรวจวัดทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์บนแผ่นฐานรองซิลิกอนจะทำขั้วไฟฟ้าบนแผ่นบริเวณที่มีความหนาแน่น โครงสร้างนาโนกระจายอยู่หนาแน่นสม่ำเสมอ และตัวตรวจวัดที่ประกอบด้วยชั้นโครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์ จะดำเนินการทั้งการเคลือบลงบนแผ่นฐานรองซิลิกอน และแผ่นกระจกสไลด์ แสดงการประกอบตัวตรวจวัดได้ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.2 การเตรียม sensor เพื่อศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของโครงสร้างนาโนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

การตรวจวัดการตอบสนองของตัวตรวจวัดโครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์ นำตัวตรวจวัด ที่เตรียมได้ไปต่อเข้าระบบตรวจวัดภายในท่อควอทซ์ และควบคุมอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้เตาท่อ (อุณหภูมิ 27 °C) ต่อเข้าระบบของการวัดการตอบสนองของตัวตรวจวัด โดยใช้ความต่างศักย์ 10 โวลต์ให้กับวงจร(input) และต่อตัวต้านทาน ( $R_L = 1 \text{ M}\Omega$ ) ดังภาพที่ 3.4 วัดค่าความต้านทานของตัวตรวจวัดในอากาศ ( $R_a$ ) บันทึกผล จากนั้นปล่อยแก๊ส ethanol และ  $\text{CO}_2$  เข้าไปในระบบในอัตราการไหล 5 L/min คำนวณค่าความต้านทานของตัวตรวจวัดในบรรยากาศของแก๊ส ethanol ( $R_s$ ) ในเวลาต่างๆ วัดค่าความต่างศักย์ที่ต่อม  $R_L$  ( $V_L$ ; Output) ค่าความต่างศักย์จะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงค่า ๆ หนึ่งจะคงที่ บันทึกค่า  $V_L$  นำค่าความต่างศักย์ที่ได้ไปคำนวณหาค่า  $R_s$  จากสมการดังต่อไปนี้

$$I_c = I_s = I_L \quad (3.1)$$

$$V_c = V_s + V_L \quad (3.2)$$

$$V_s = IR_s \quad (3.3)$$

เมื่อ  $V_c$  คือ ค่าความต่างศักย์ที่ป้อนในวงจร มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)

$V_s$  คือ ค่าความต่างศักย์ที่คำนวณได้ มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)

$V_L$  คือ ค่าความต่างศักย์ตกคร่อม  $R_L$  มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)

$I_c, I_s, I_L$  คือ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

ค่าการตอบสนอง (Sensitivity,  $S$ ) ของ semiconducting gas sensor โดยทั่วไปจะนิยามโดย

$$S = R_s / R_a \quad (3.4)$$

เมื่อ  $S$  คือ ค่าความไว (sensitivity) ต่อการตอบสนองต่อแก๊ส

$R_a$  คือ ค่าความต้านทานของ sensor ในอากาศ มีหน่วยเป็นโอห์ม ( $\Omega$ )

$R_s$  คือ ค่าความต้านทานของ sensor ในแก๊ส มีหน่วยเป็นโอห์ม ( $\Omega$ )

การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของตัวตรวจวัด เราเลือกเงื่อนไขที่เกิดโครงสร้างนาโนแบบมิติหนึ่งบนผงวัสดุตัวอย่าง และฐานรองซิลิกอนที่มีความหนาแน่นและสม่ำเสมอมากที่สุด การเตรียมตัวตรวจวัดเริ่มจากนำวัสดุตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ มาทำให้แตกกระจาย(disperse)ในเอทานอล ด้วยการสั่นของเครื่อง ultra sonic นำวัสดุที่ได้มาผสมผสมด้วยน้ำกลั่นหรือ PVA (polyvinyl alcohol) จน

กลายเป็นแป้งเปียกเคลือบลงบนแผ่นแก้วสไลด์ แล้วนำไปอบให้แห้ง ทำซ้ำด้วยกาวเงิน (silver paint) ทั้งสองข้าง แล้วอบอีกครั้ง จากนั้นทำซ้ำด้วยลวดทองแดง นำตัวตรวจวัดการตอบสนองต่อแก๊สที่ได้ไปติดตั้งในท่อควอทซ์ และดำเนินการทดลอง การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของตัวตรวจวัดคอปเปอร์ออกไซด์โครงสร้างนาโน ทินไดออกไซด์โครงสร้างนาโน และวัสดุผสมโครงสร้างนาโนของคอปเปอร์ออกไซด์และทินไดออกไซด์